

О ГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3
Глава I. Физические основы горения дуги	
§ 1. Основные процессы, протекающие в дуговом разряде	6
§ 2. Плазматрон как источник низкотемпературной плазмы	10
§ 3. Схемы плазматронов, сравнительная оценка достигнутых параметров	17
Глава II. Конструктивные схемы плазматронов	
§ 1. Плазматроны с вихревой стабилизацией дугового разряда	26
§ 2. Плазматрон с вращением дугового разряда под действием электродинамических сил	29
§ 3. Плазматрон комбинированной схемы	33
Глава III. Источники электрического питания и стендовые системы для плазматронов большой мощности.	
§ 1. Устойчивость системы «источник питания — дуга». Условия совместности источников электрического питания и подогревателей	38
§ 2. Источники электрического питания и их характеристики	44
§ 3. Системы зажигания плазматронов	52
§ 4. Измерения на плазматронных установках	56
§ 5. Гидравлические и пневматические системы плазматронных установок	67
§ 6. Вопросы техники безопасности при работе на электродуговых установках	69
Глава IV. Характеристики дугового разряда и зависимость его параметров от режимов работы плазматрона	
§ 1. Особенности вольт-амперных характеристик дугового разряда в плазматронах	72
§ 2. Зависимость падения напряжения в дуговом разряде от давления в разрядной камере, массового расхода газа и индукции магнитного поля	76
§ 3. Зависимость напряжения дугового разряда в безразмерной форме	80
§ 4. Обобщение экспериментальных данных в безразмерной форме	93
§ 5. О характерных значениях удельной энталпии и удельной электропроводности	101
Глава V. Экспериментальные характеристики плазматрона как генератора низкотемпературной плазмы	
§ 1. Коэффициент полезного действия системы генерации плазмы	106
§ 2. Зависимость среднемассовой температуры рабочего тела на выходе из плазматрона от режима его работы	115
§ 3. Некоторые характеристики высокотемпературной струи	119
Литература	125